

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】平成 25 年 9 月 19 日 (2013.9.19)

【公開番号】特開 2012-44460 (P2012-44460A)

【公開日】平成 24 年 3 月 1 日 (2012.3.1)

【年通号数】公開・登録公報 2012-009

【出願番号】特願 2010-184279 (P2010-184279)

【国際特許分類】

H 0 4 N 5/225 (2006.01)

G 0 3 B 17/02 (2006.01)

G 0 3 B 17/04 (2006.01)

G 0 3 B 17/18 (2006.01)

【F I】

H 0 4 N 5/225 F

G 0 3 B 17/02

H 0 4 N 5/225 Z

G 0 3 B 17/04

G 0 3 B 17/18 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 8 月 8 日 (2013.8.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ヒンジ部により機器本体に対して開閉及び回転可能に連結された可動部を有する電子機器であって、

前記可動部は、

第 1 の磁場発生手段と、

当該可動部を前記機器本体に対して回転させるときの回転軸を挟んで、前記第 1 の磁場発生手段と略対称な位置に配置される第 2 の磁場発生手段と、を有し、

前記機器本体は、

前記可動部を当該機器本体に対して閉じた状態において、前記第 1 の磁場発生手段及び前記第 2 の磁場発生手段のいずれか一方と対向する位置の近傍に配置される第 1 の磁場検出手段と、

前記可動部を当該機器本体に対して開閉させるときの開閉軸の近傍に配置される第 2 の磁場検出手段と、

前記第 1 の磁場検出手段及び前記第 2 の磁場検出手段の出力信号に基づいて、前記可動部の当該機器本体に対する可動状態に応じた制御を行う制御手段と、を有し、

前記第 1 の磁場検出手段は、双極の磁場が検出可能であって、検出した磁場の向きに応じて異なる信号を出力し、

前記制御手段は、前記第 1 の磁場検出手段の出力信号と前記第 2 の磁場検出手段の出力信号とが所定の組み合わせであった場合、当該所定の組み合わせの出力信号が得られる直前に得られた出力信号に基づく制御と同様の制御を行うことを特徴とする電子機器。

【請求項 2】

前記制御手段は、前記第 1 の磁場検出手段の出力信号と前記第 2 の磁場検出手段の出力

信号とが所定の組み合わせであった場合、当該所定の組み合わせの出力信号を無視して、当該所定の組み合わせの出力信号が得られる直前に得られた出力信号に基づく制御を継続させることを特徴とする請求項 1 に記載の電子機器。

【請求項 3】

ヒンジ部により機器本体に対して開閉及び回転可能に連結された可動部を有する電子機器であって、

前記可動部は、

第 1 の磁場発生手段と、

当該可動部を前記機器本体に対して回転させるときの回転軸を挟んで、前記第 1 の磁場発生手段と略対称な位置に配置される第 2 の磁場発生手段と、を有し、

前記機器本体は、

前記可動部を当該機器本体に対して閉じた状態において、前記第 1 の磁場発生手段及び前記第 2 の磁場発生手段のいずれか一方と対向する位置の近傍に配置される第 1 の磁場検出手段と、

前記可動部を当該機器本体に対して開閉させるときの開閉軸の近傍に配置される第 2 の磁場検出手段と、

前記第 1 の磁場検出手段及び前記第 2 の磁場検出手段の出力信号に基づいて、前記可動部の当該機器本体に対する可動状態に応じた制御を行う制御手段と、を有し、

前記第 1 の磁場検出手段は、双極の磁場が検出可能であって、検出した磁場の向きに応じて異なる信号を出力し、

前記制御手段は、前記第 1 の磁場検出手段がいずれの向きの磁場も検出していない状態において、第 1 の向きの磁場を検出した場合にはいずれの向きの磁場も検出していない状態と異なる制御を行い、第 2 の向きの磁場を検出した場合にはいずれの向きの磁場も検出していない状態と同様の制御を行うことを特徴とする電子機器。

【請求項 4】

前記制御手段は、前記第 2 の磁場検出手段の出力信号に応じて、前記第 1 の磁場検出手段が前記第 1 の向きの磁場を検出したときに行う制御と前記第 2 の向きの磁場を検出したときに行う制御とを切り換えることを特徴とする請求項 3 に記載の電子機器。

【請求項 5】

前記可動部は、画像を表示する表示手段を有しており、

前記制御手段は、前記第 1 の磁場検出手段及び前記第 2 の磁場検出手段の出力信号に基づいて、前記可動部の当該機器本体に対する可動状態に応じた前記表示手段の表示制御を行うことを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載の電子機器。

【請求項 6】

前記第 1 の磁場発生手段及び前記第 2 の磁場発生手段は、前記回転軸に直交する方向において前記表示手段の表示面と重ならない位置に配置されることを特徴とする請求項 5 に記載の電子機器。

【請求項 7】

前記可動部は、前記ヒンジ部側の端に沿って配置される金属部材を有し、

前記第 1 の磁場発生手段及び前記第 2 の磁場発生手段は、前記金属部材よりも前記回転軸から離れた位置に配置されることを特徴とする請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 項に記載の電子機器。

【請求項 8】

前記機器本体は、被写体を撮像する撮像手段を有することを特徴とする請求項 1 ないし 7 のいずれか 1 項に記載の電子機器。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 0 9 】

上記の目的を達成するために、本発明に係る電子機器は、ヒンジ部により機器本体に対して開閉及び回転可能に連結された可動部を有する電子機器であって、前記可動部は、第1の磁場発生手段と、当該可動部を前記機器本体に対して回転させるときの回転軸を挟んで、前記第1の磁場発生手段と略対称な位置に配置される第2の磁場発生手段と、を有し、前記機器本体は、前記可動部を当該機器本体に対して閉じた状態において、前記第1の磁場発生手段及び前記第2の磁場発生手段のいずれか一方と対向する位置の近傍に配置される第1の磁場検出手段と、前記可動部を当該機器本体に対して開閉させるときの開閉軸の近傍に配置される第2の磁場検出手段と、前記第1の磁場検出手段及び前記第2の磁場検出手段の出力信号に基づいて、前記可動部の当該機器本体に対する可動状態に応じた制御を行う制御手段と、を有し、前記第1の磁場検出手段は、双極の磁場が検出可能であって、検出した磁場の向きに応じて異なる信号を出力し、前記制御手段は、前記第1の磁場検出手段の出力信号と前記第2の磁場検出手段の出力信号とが所定の組み合わせであった場合、当該所定の組み合わせの出力信号が得られる直前に得られた出力信号に基づく制御と同様の制御を行うことを特徴とする。

【 手続補正 3 】

【 補正対象書類名 】 明細書

【 補正対象項目名 】 0 0 1 0

【 補正方法 】 変更

【 補正の内容 】

【 0 0 1 0 】

また、上記の目的を達成するために、本発明に係る電子機器は、ヒンジ部により機器本体に対して開閉及び回転可能に連結された可動部を有する電子機器であって、前記可動部は、第1の磁場発生手段と、当該可動部を前記機器本体に対して回転させるときの回転軸を挟んで、前記第1の磁場発生手段と略対称な位置に配置される第2の磁場発生手段と、を有し、前記機器本体は、前記可動部を当該機器本体に対して閉じた状態において、前記第1の磁場発生手段及び前記第2の磁場発生手段のいずれか一方と対向する位置の近傍に配置される第1の磁場検出手段と、前記可動部を当該機器本体に対して開閉させるときの開閉軸の近傍に配置される第2の磁場検出手段と、前記第1の磁場検出手段及び前記第2の磁場検出手段の出力信号に基づいて、前記可動部の当該機器本体に対する可動状態に応じた制御を行う制御手段と、を有し、前記第1の磁場検出手段は、双極の磁場が検出可能であって、検出した磁場の向きに応じて異なる信号を出力し、前記制御手段は、前記第1の磁場検出手段がいずれの向きの磁場も検出していない状態において、第1の向きの磁場を検出した場合にはいずれの向きの磁場も検出していない状態と異なる制御を行い、第2の向きの磁場を検出した場合にはいずれの向きの磁場も検出していない状態と同様の制御を行うことを特徴とする。